SECTION G — PHYSIQUE

G01 MÉTROLOGIE; ESSAIS

G01Q TECHNIQUES OU APPAREILS À SONDE À BALAYAGE; APPLICATIONS DES TECHNIQUES DE SONDE À BALAYAGE, p.ex. MICROSCOPIE À SONDE À BALAYAGE [SPM] [2010.01]

Note(s) [2010.01]

Dans la présente sous-classe, la règle de la première place est appliquée, c. à d. à chaque niveau hiérarchique, le classement s'effectue à la première place appropriée.

10/00 Dispositions pour le balayage ou le positionnement, c. à d. dispositions pour commander de manière active le mouvement ou la position de la sonde [2010.01]

10/02 • Balayage ou positionnement grossier **[2010.01]**

10/04 • Balayage ou positionnement fin **[2010.01]**

10/06 • • Circuits ou algorithmes à cet effet **[2010.01]**

20/00 Contrôle du mouvement ou de la position de la sonde [2010.01]

20/02 • par des moyens optiques **[2010.01]**

20/04 • Sondes auto-détectrices, c. à d. dans lesquelles la sonde génère elle-même un signal représentatif de sa position, p.ex. jauge piézoélectrique **[2010.01]**

30/00 Moyens auxiliaires destinés à assister ou améliorer les techniques ou les appareils à sonde à balayage, p.ex. dispositifs d'affichage ou de traitement de données [2010.01]

30/02 • Dispositifs d'analyse d'un type autre que la microscopie à sonde à balayage SPM, p.ex. microscope électronique à balayage SEM [Scanning Electron Microscope], spectromètre ou microscope optique **[2010.01]**

30/04 • Dispositifs d'affichage ou de traitement de données **[2010.01]**

30/06 • • pour compensation d'erreurs **[2010.01]**

30/08 • Moyens pour établir ou réguler des conditions ambiantes souhaitées au sein d'une enceinte d'échantillonnage **[2010.01]**

30/10 • • thermiques **[2010.01]**

30/12 • • avec fluide **[2010.01]**

30/14 • • • avec liquide **[2010.01]**

30/16 • • sous vide **[2010.01]**

30/18 • Moyens pour protéger ou isoler l'intérieur d'une enceinte d'échantillonnage contre les conditions ou les facteurs environnementaux externes, p.ex. les vibrations ou les champs électromagnétiques **[2010.01]**

30/20 • Dispositifs ou procédés de manipulation d'échantillons **[2010.01]**

40/00 Étalonnage, p.ex. des sondes [2010.01]

40/02 • Leurs normes d'étalonnage ou procédés de fabrication **[2010.01]**

60/00 Types particuliers de microscopie à sonde à balayage SPM [Scanning-Probe Microscopy] ou appareils à cet effet; Composants essentiels de ceux-ci [2010.01]

60/02 • Microscopie à sonde à balayage de type multiple, c. à d. incluant au moins deux techniques SPM **[2010.01]**

60/04 • • Microscopie à effet tunnel à balayage STM [Scanning Tunnelling Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] **[2010.01]**

60/06 • • Microscopie optique à champ proche à balayage SNOM [Scanning Near-Field Optical Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] **[2010.01]**

60/08 • • Microscopie à forces magnétiques MFM [Magnetic Force Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] **[2010.01]**

60/10 • Microscopie à effet tunnel à balayage STM [Scanning Tunnelling Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes STM **[2010.01]**

60/12 • • Spectroscopie à effet tunnel à balayage STS [Scanning Tunnelling Spectroscopy] **[2010.01]**

60/14 • • Potentiométrie à effet tunnel à balayage STP [Scanning Tunnelling Potentiometry] **[2010.01]**

60/16 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports **[2010.01]**

60/18 • Microscopie optique à champ proche à balayage SNOM [Scanning Near-Field Optical Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SNOM **[2010.01]**

60/20 • • Fluorescence **[2010.01]**

60/22 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports **[2010.01]**

60/24 • Microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes AFM **[2010.01]**

60/26 • • Microscopie à forces de frottement **[2010.01]**

60/28 • • Microscopie à forces d'adhérence **[2010.01]**

60/30 • • Microscopie à mesure de potentiel à balayage **[2010.01]**

60/32 • • Mode vibrant **[2010.01]**

60/34 • • • Mode à contact périodique **[2010.01]**

60/36 • • Mode statique **[2010.01]**

60/38 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports **[2010.01]**

60/40 • • • Sondes conductrices **[2010.01]**

60/42 • • • Fonctionnalisation **[2010.01]**

60/44 • Microscopie à conductance ionique à balayage SICM [Scanning Ion-Conductance Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SICM **[2010.01]**

60/46 • Microscopie capacitive à balayage SCM [Scanning Capacitance Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SCM **[2010.01]**

60/48 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports **[2010.01]**

60/50 • Microscopie à forces magnétiques MFM [Magnetic Force Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes MFM **[2010.01]**

60/52 • • Résonance **[2010.01]**

60/54 • • Sondes, leur fabrication ou leur appareillage connexe, p.ex. supports **[2010.01]**

60/56 • • • Sondes à revêtement magnétique **[2010.01]**

60/58 • Microscopie thermique à balayage SThM [Scanning Thermal Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SThM **[2010.01]**

60/60 • Microscopie électrochimique à balayage SECM [Scanning Electro-Chemical Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SECM **[2010.01]**

70/00 Aspects généraux des sondes SPM, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, dans la mesure où ces sondes ne sont pas spécialement adaptées à une seule technique SPM couverte par le groupe G01Q 60/00 [2010.01]

70/02 • Supports de sondes **[2010.01]**

70/04 • • à compensation des erreurs induites par la température ou les vibrations **[2010.01]**

70/06 • Réseaux de pointes de sondes **[2010.01]**

70/08 • Caractéristiques des sondes **[2010.01]**

70/10 • • Forme ou cônicité **[2010.01]**

70/12 • • • Pointes de nanotubes **[2010.01]**

70/14 • • Matériaux particuliers **[2010.01]**

70/16 • Fabrication des sondes **[2010.01]**

70/18 • • Fonctionnalisation **[2010.01]**

80/00 Applications des techniques de sonde à balayage, autres que les techniques SPM (fabrication ou traitement des microstructures B81C; fabrication ou traitement des nanostructures B82B 3/00; enregistrement ou reproduction d'informations utilisant des interactions en champ proche G11B 9/12, G11B 11/24 ou G11B 13/08) **[2010.01]**

90/00 Techniques ou appareils à sonde à balayage non prévus ailleurs [2010.01]